

# 半導体・液晶製造業の PFC削減取組みについて

2007年1月29日

(社)電子情報技術産業協会

# 説明内容

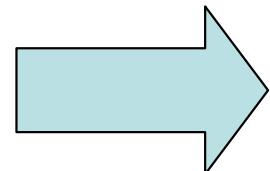
---

- 今までの対策  
フロン削減(オゾン層保護)、脱フロン温暖化対策
- 削減活動の温室効果ガス
- 自主行動計画と排出量の推移
- 排出削減対策と自主行動計画の見通し
- 海外との連携・協調(WSC・WLICC)
- まとめ
- 参考資料

# これまでの対策

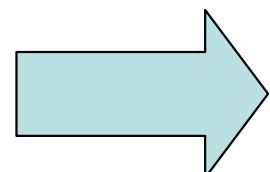
半導体／液晶業界では **オゾン層破壊物質は既に全廃**  
フロンの半導体／液晶における用途は

- 精密洗浄
- CVDやドライエッチなどのプロセスガス
- クリーンルームの消火器など



代替フロン等3ガスへ移行

しかし、脱フロン(オゾン層破壊物質)で代替化した物質、その他  
プロセスで使用しているガスに「京都議定書」で指定された温室  
効果を有するPFCなどがある



温室効果ガス排出量(代替フロン等3ガス)の削減<sub>3</sub>

# 温室効果ガス(SF6・PFC・HFC)

- 半導体・液晶産業での削減活動のPFC等ガスは…

PFC s: CF<sub>4</sub>、C<sub>2</sub>F<sub>6</sub>、C<sub>3</sub>F<sub>8</sub>、C<sub>4</sub>F<sub>8</sub>

HFC s: CHF<sub>3</sub> SF<sub>6</sub> / NF<sub>3</sub>\* 以上の7種類

\*) 自主行動計画に含めている

- SF<sub>6</sub>・PFCなどは、半導体、液晶の製造工程で性能を決定する反応ガスの一つとして、また製造装置のクリーニング用途のガスとして使用
- 反応ガスとは、製品を加工し(トランジスタやトランジスタの配線を形成)、LSI／液晶の性能、品質、生産性を決定する重要な要素の一つ

半導体及び液晶製造において、PFC等ガスは  
不可欠なプロセスガスとして使用

\* 使用工程は参考資料をご参照ください。

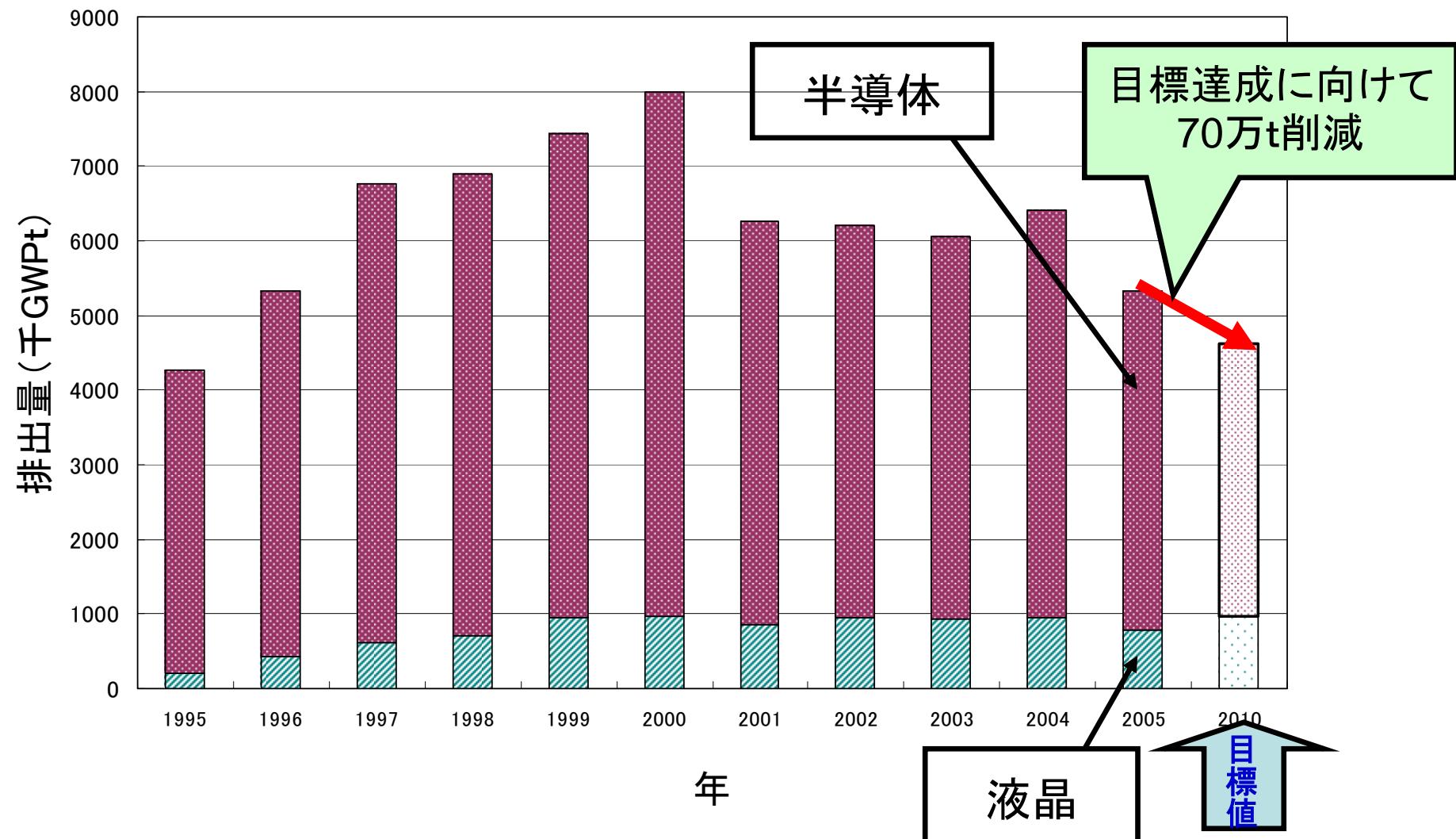
# 自主行動計画と排出量の推移

- **自主行動計画**

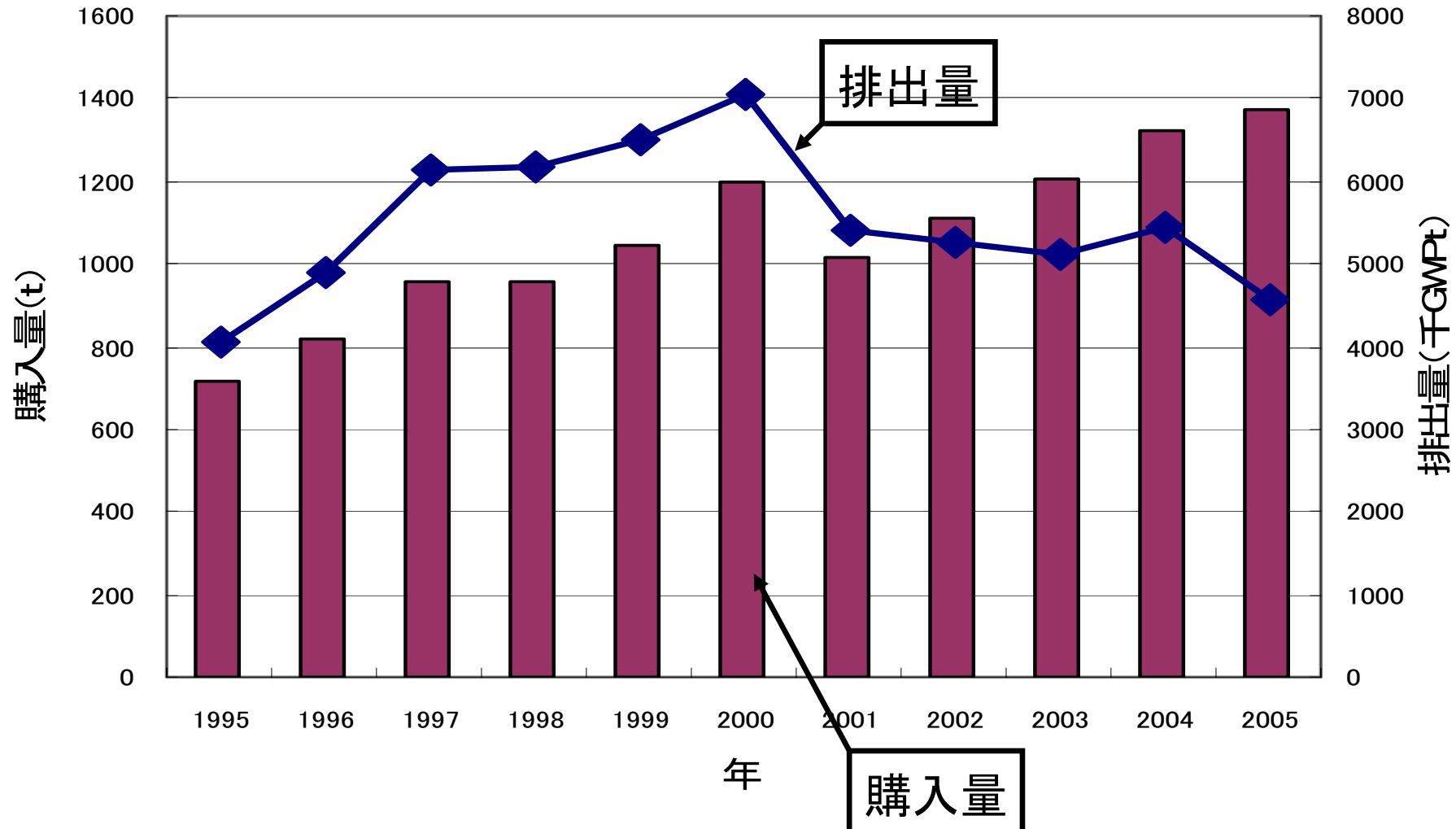
半導体 ⇒ 「2010年の排出量を1995年(基準年)比  
で10%以上削減する」  
液晶 → 「2010年の排出量を2000年(基準年)比  
同等以下とする」
- **排出実績推移と対策**

生産増等に伴う購入量が増加しているが、除害装置  
設置等の効果的な対策を実施し、行動計画の達成に  
向け着実に推進し、目標達成の見込み。

# 半導体・液晶製造業の排出量の推移

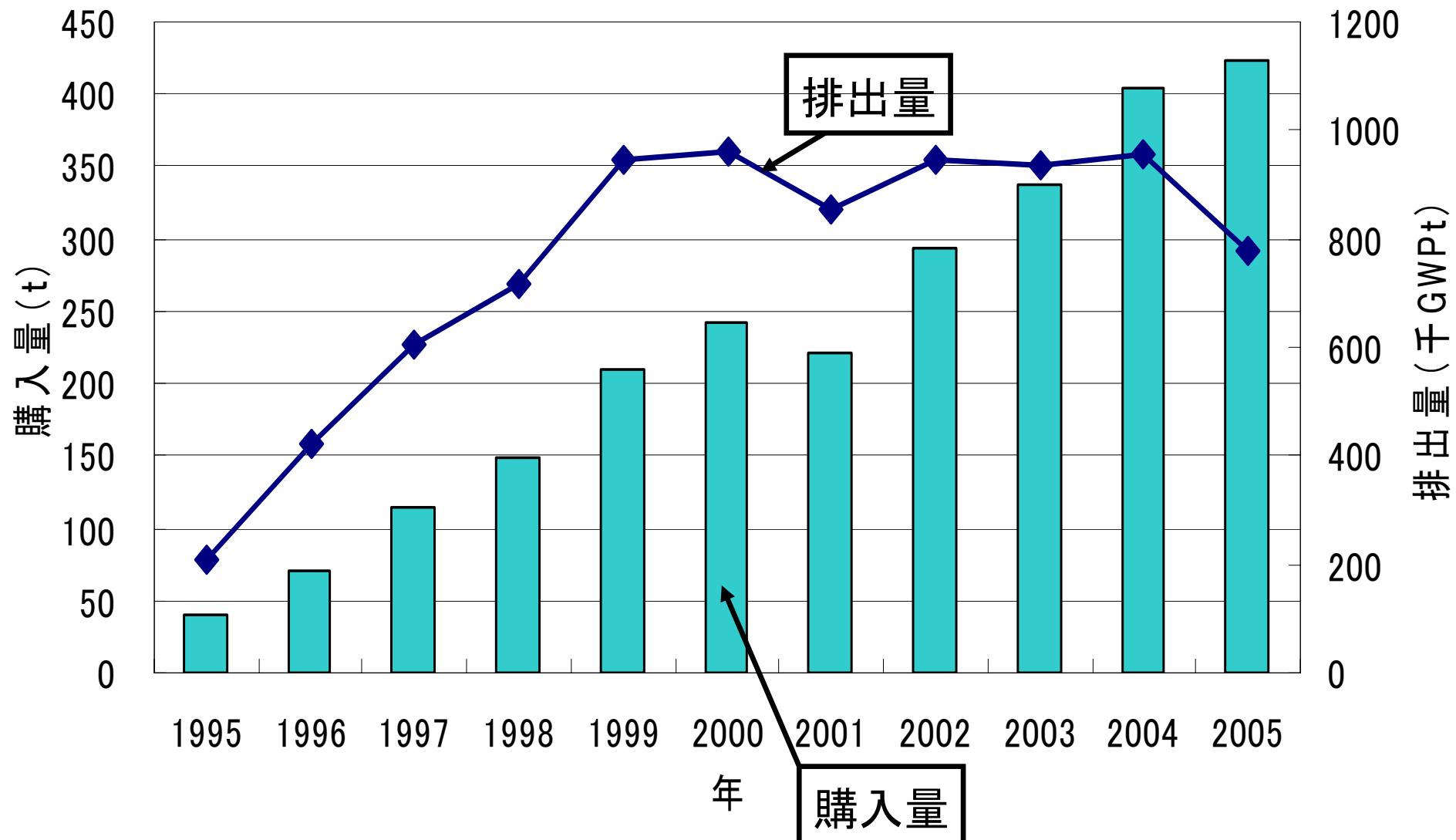


# PFC購入量と排出実績の推移(半導体)



生産増等に伴い購入量が増加しているが、対策効果により排出は削減

# PFC購入量と排出実績の推移(液晶)



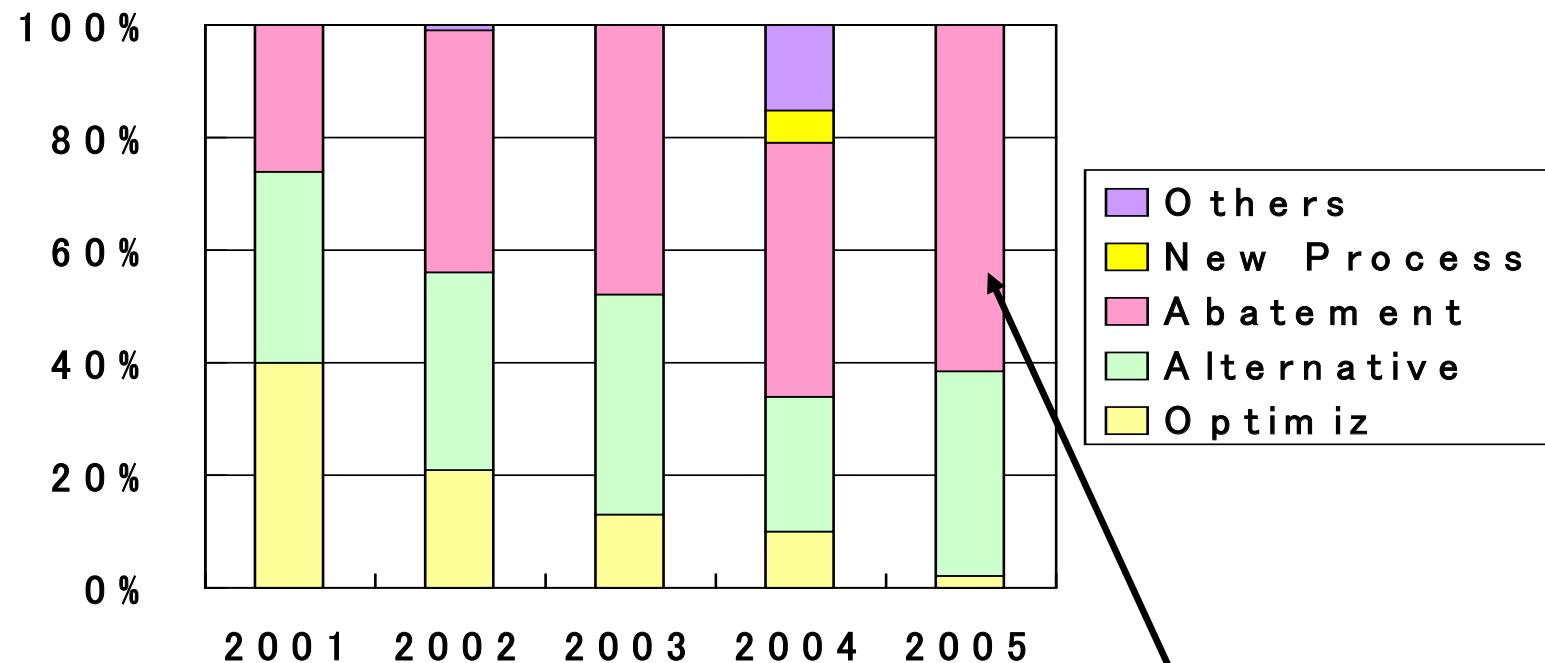
半導体同様に購入量が増加しているが、対策効果により排出削減

# 排出削減対策と今後の見通し

- 排出削減対策
  - ・削減対策事例
  - ・除害装置設置率推移
- 自主行動計画の見通し

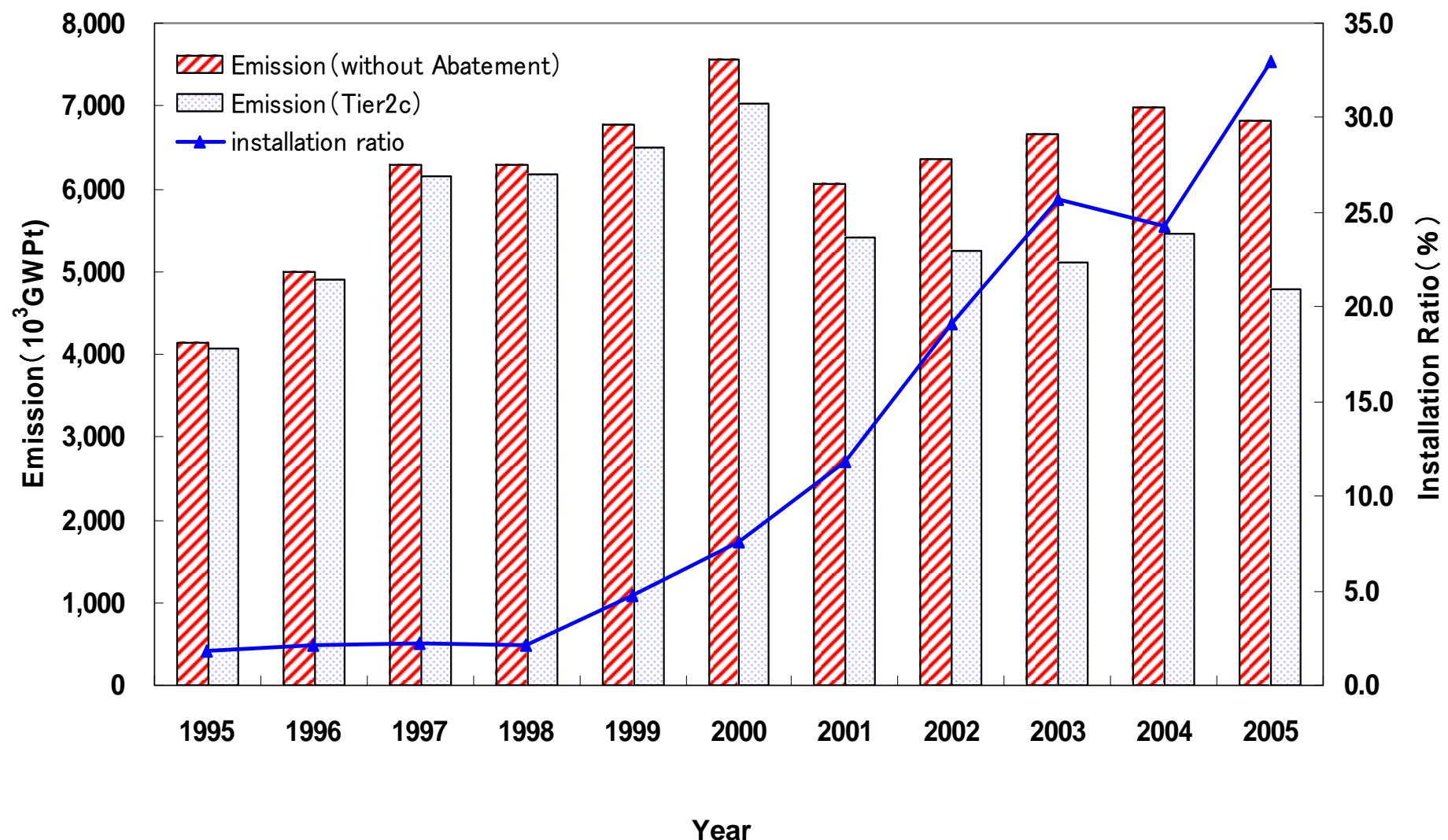
# 排出削減対策(半導体)

- 削減施策の3本柱であるプロセス最適化、代替化、除害装置設置等を着実に実行しており、これらの結果が確実な効果を表した。
- 2005年の対策実績は、除害装置設置と代替ガスの2本柱となっている。除害装置設置施策は費用の負担は大きいが、効果はすぐに現れる。



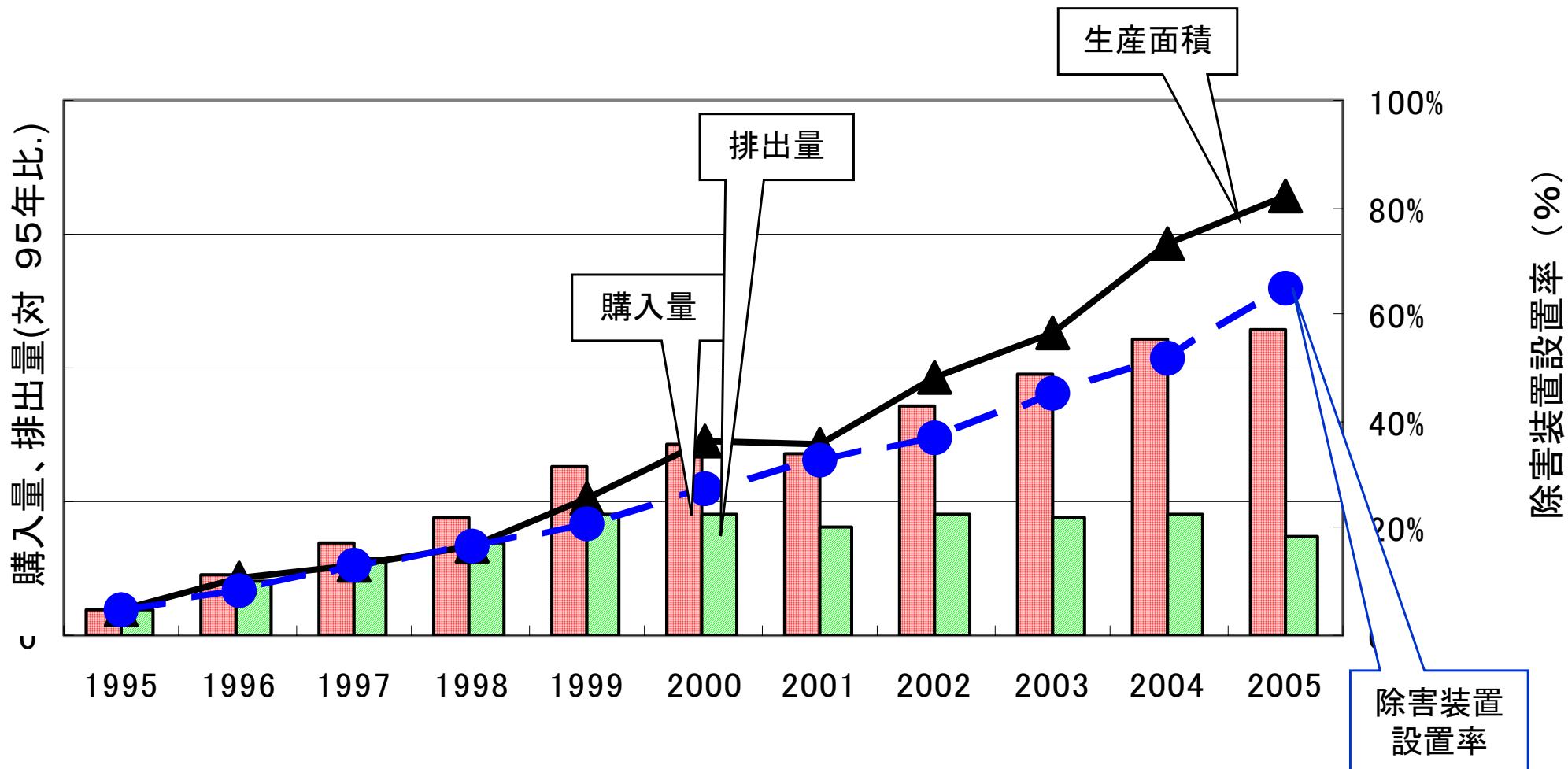
最適化施策が減少し削減施策が3本柱から2本柱へ(除害装置導入中心)

# PFC除害装置設置率の推移(半導体)



削減効果の大きい除害装置の設置による排出削減

# 除害装置設置率推移と排出実績(液晶)



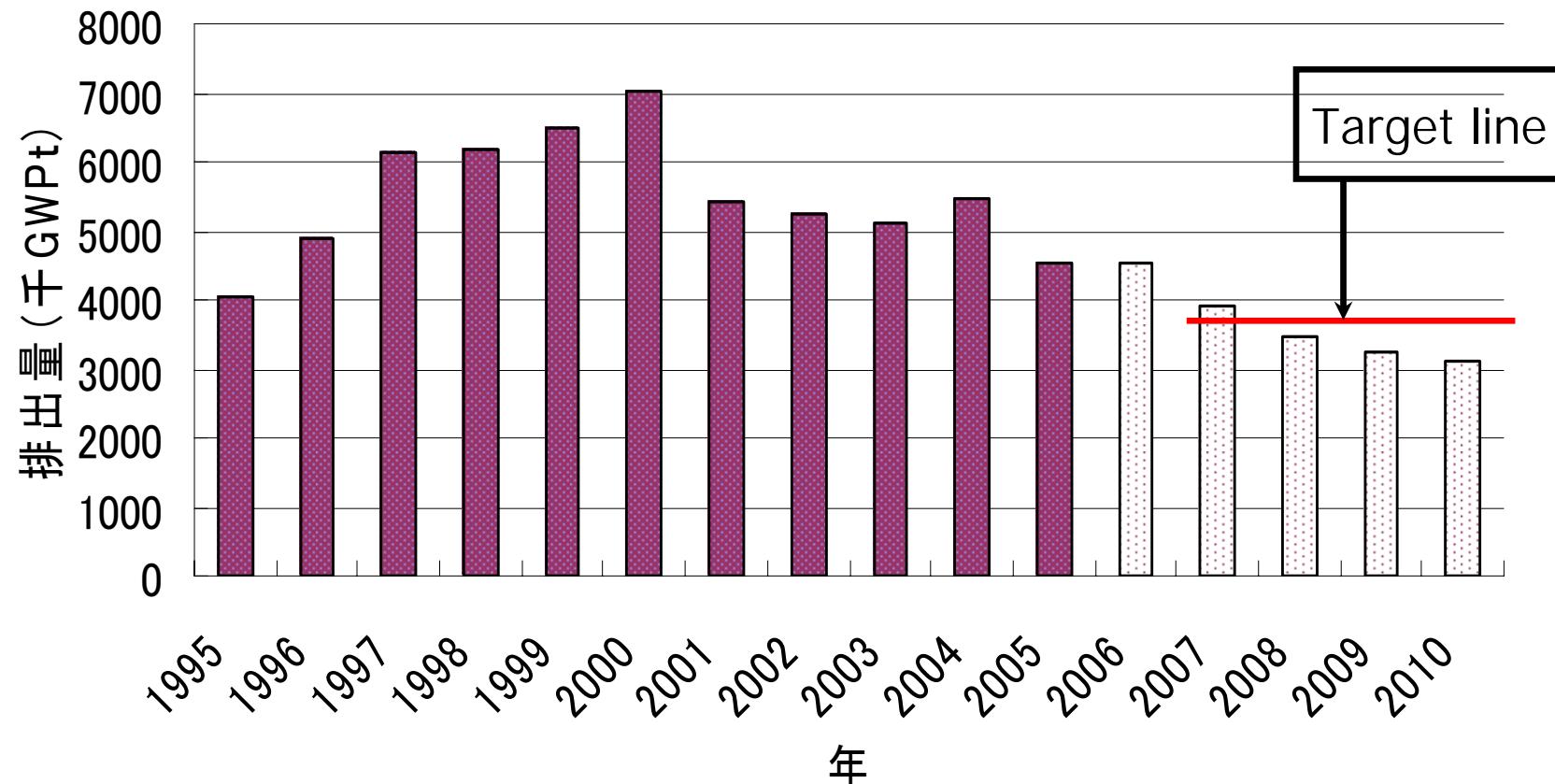
購入量は生産面積増加に応じ増加しているが、  
排出量は1999年以降、除害装置等の効果により削減

# 自主行動計画の見通し

- ・ 生産増等に伴う購入量が増加しているが、除害装置設置等の効果的な対策を実施し、  
自主行動計画の達成に向け着実に推進
- ・ 半導体、液晶製造ともに、自主行動計画  
目標を達成の見込み

除害装置設置に対する政府の支援施策は、目標達成に向けて後押しとなります。

# 2010年までのPFC排出量予測(半導体)



削減対策を継続して推進し、業界全体として達成可能な見込み

# 海外との連携・協調(WSC・WLICC)

## 半導体の取組み

### WSC(世界半導体会議)

半導体分野では激しい国際競争の渦中にあるものの、代替フロン(温室効果ガス排出抑制について、日本がリーダーシップをとり世界半導体会議の場で日・米・欧・韓・台の各半導体業界の協力のもと、削減目標に定め、着実に成果を挙げています。2006年には中国がWSCに加盟し中国の温室効果ガス削減に協力しています。

## 液晶の取組み

### WLICC(世界液晶産業協力会議 )

液晶分野でも 日本がリーダーシップをとり、2001年に世界液晶産業協力会議を設立し韓国・台湾に対し代替フロンの削減を働きかけ、2003年に国際的な排出抑制のルール化に成功しました。なお、JEITA液晶産業のPFCの自主排出削減活動は、日刊工業新聞社主催の『地球温暖化防止大賞(経済産業大臣賞)』を受賞しました。

\* WSC・WLICCの活動は参考資料をご参照ください。

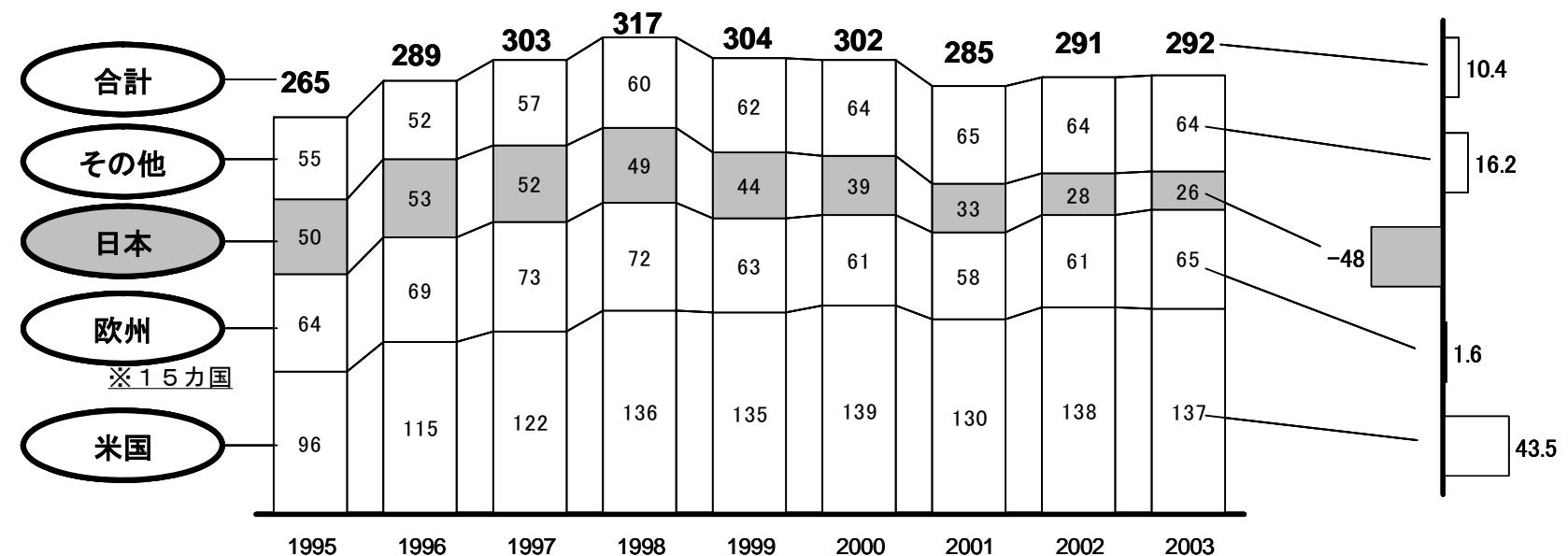
# <参考>諸外国の代替フロン等3ガス排出削減の状況

2003年時点で、京都議定書付属書Ⅰ国全体の3ガス(HFC、PFC、SF6)の排出量は基準年とくらべて約10%増加している。そのなかで、我が国の排出量は48%減少している。

付属文書Ⅰ国の代替フロン等3ガス排出量推移

(百万GWPt)

1995年からの増加率  
(パーセント)



資料: UNFCCC。なお、ロシア、ポーランドにおいて、データがない年は、前年と同様と仮定

出典:産業構造審議会化学・バイオ部会第13回地球温暖化防止対策小委員会

(平成18年6月21日) 「参考資料1」より抜粋

# まとめ

---

- PFC等ガスは半導体・液晶製造にとって不可欠なガスです。
- 半導体・液晶の生産増等に伴い、使用量も増加していますが、除害装置設置等の効果のある対策を実施、自主行動計画の達成に向けて推進しています。  
※ 除害装置設置に対する政府の支援施策は、目標達成に向けて後押しとなります。
- グローバルでの温暖化対策を、日本がリーダーシップを発揮し、推進しています。
- 半導体、液晶等電子デバイスの技術革新、進展は、多くの産業の温暖化対策に貢献しています。

## <参考資料>

- 1.半導体・液晶の製造工程と使用工程
- 2.WSC、WLICCでの海外連携
- 3.半導体・液晶の応用製品と省エネ貢献

# 半導体製造工程の紹介

JEITA

## 半導体のできるまで

Semiconductor Manufacturing Process

### 回路設計・パターン設計



お客様の要求機能に応じた  
さまざまな問題を組み合わせ、  
パターンの設計をするんだ。

キャラクターのPCに、どのような回路を、いかに簡単に  
実現するかと、回路図を作成するんだ。

### フォトマスク作成



このフォトマスクでウェーハの表面に回路のパターンを  
焼き付けるんだ。

### インゴットの引き上げ



半導体のベースになるシリコンの单結晶を  
つくるんだ。重量にゆっくり引き上げると品質のいい  
单結晶ができるんだ。

单結晶を一端とて温湯の中で溶解し、  
残余溶液を回転させながら單々に引上げる必  
要な工程の单結晶炉(インゴット)を持つね。

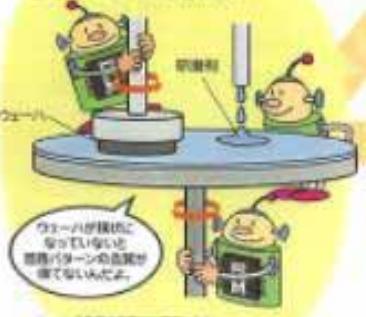
### インゴットの切断



インゴットを  
切ると、インゴットは  
とても硬いので特殊な  
ダイヤモンドブレードを  
つかって切断するんだ。

ダイヤモンドブレードの刃先の部分に  
溶けた、ウェーハがつきます。

### ウェーハの研磨



ウェーハが複数にな  
り、回路パターンの実現が  
難しくなるんだ。

### ウェーハ表面を酸化



回路パターンを  
焼き付けるために、  
ウェーハに酸化膜を  
つけなんだ。

ウェーハ両面の表面が(300nm~1.1μm)の中  
で酸化性雰囲気にさらし、表面に酸化膜を成長させます。

### 前工程

### PFC・SF6使用工程



エッティングでいらない  
酸化膜をとるんだよ。

エッティング槽  
ガス  
ウェーハ  
真空ボンベ

SEAJ 社団法人 日本半導体製造装置協会

### 酸化・拡散・CVD・イオン注入



ウェーハに電子を  
つくり込んだ。  
必要なイオンを打ち込んで  
電子をつくるんだ。

ウェーハにイオン注入(オゾンノン)や  
表面処理を行なうとシリコンが並  
いも部分だけが半導体になります。

### 平坦化(CMP)



ウェーハ表面を研磨し、パターンの  
凹凸を削除します。

ウェーハ  
エラシシング・フレート  
エラシシング・フレート  
砥石

### 電極形成



ウェーハの表面に  
電極配線用の  
アルミニウム膜を  
つくるんだ。

半導体上スピラスマによりアルミターゲットを  
スリーブで回す。ウェーハ表面に電極配線用  
のアルミニウム膜を形成します。

### フォトレジスト塗布



フォトレジストとい  
う感光剤をウェーハの表面に  
塗布するんだ。

フォトレジスト  
ウェーハ

フォトレジストを塗めて裏に向いて置きして、ウェーハに  
曝光を行ないます。

### ウェーハ検査



1枚のウェーハに  
たくさん回路パターンが  
できたよ。これを検査してから  
ダイヤモンドブレードで  
切り分けるんだ。

OK!! ウェーハ  
ダップ

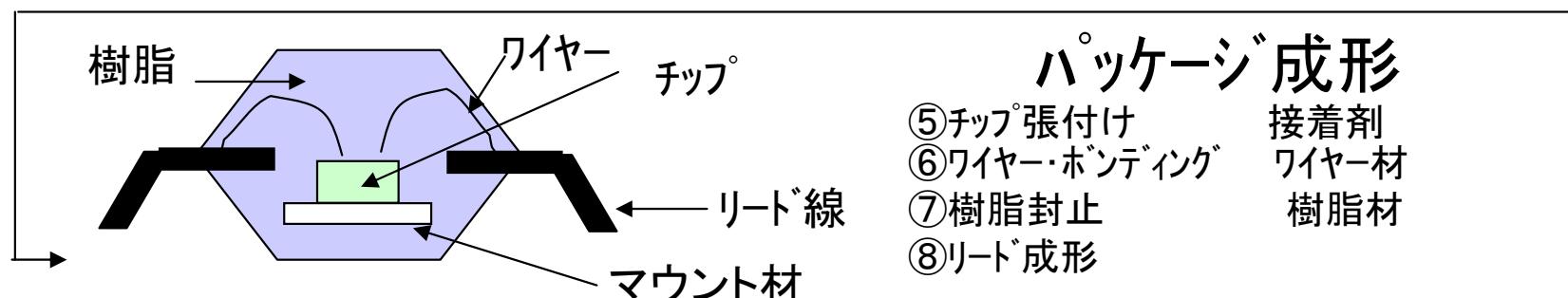
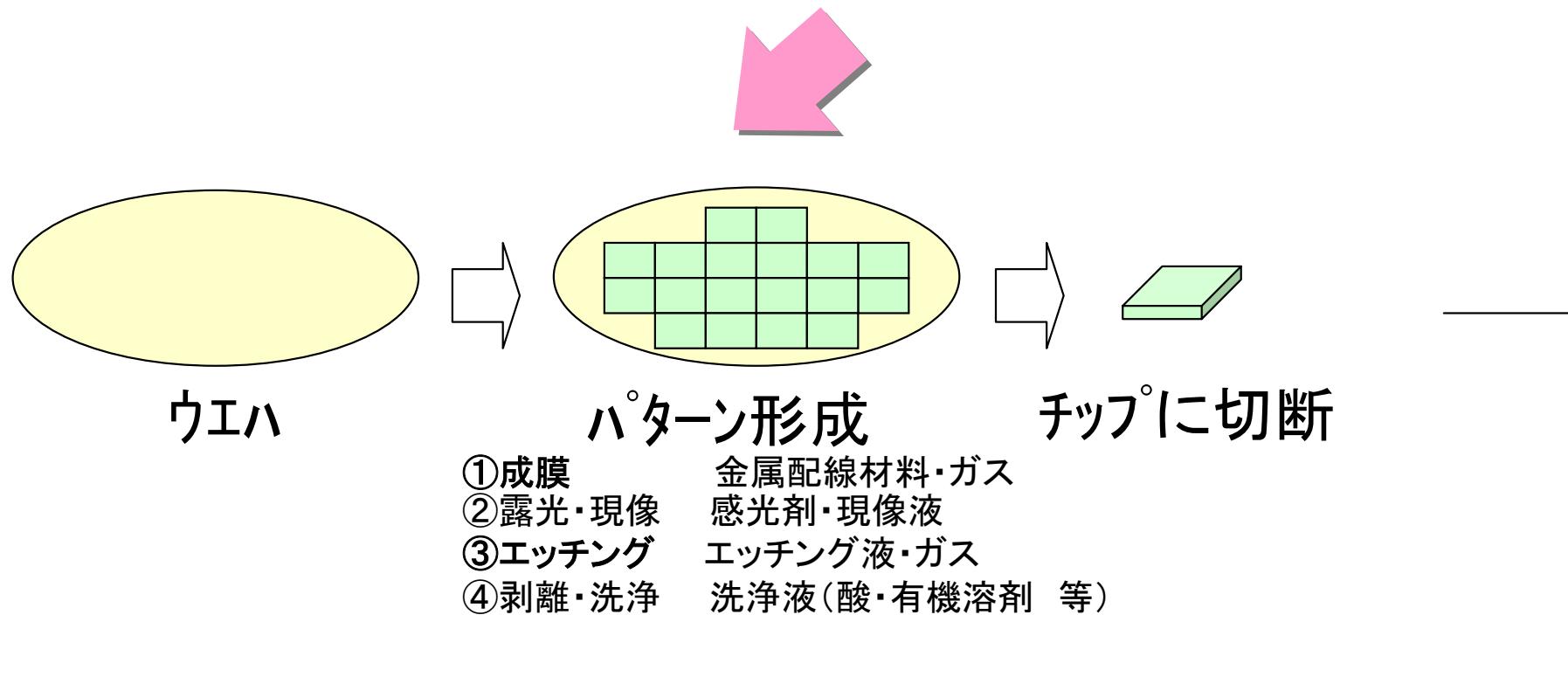
ウェーハをラインごとに検査し、  
良品・不良品を判定し、不良品  
にはマークをつけます。



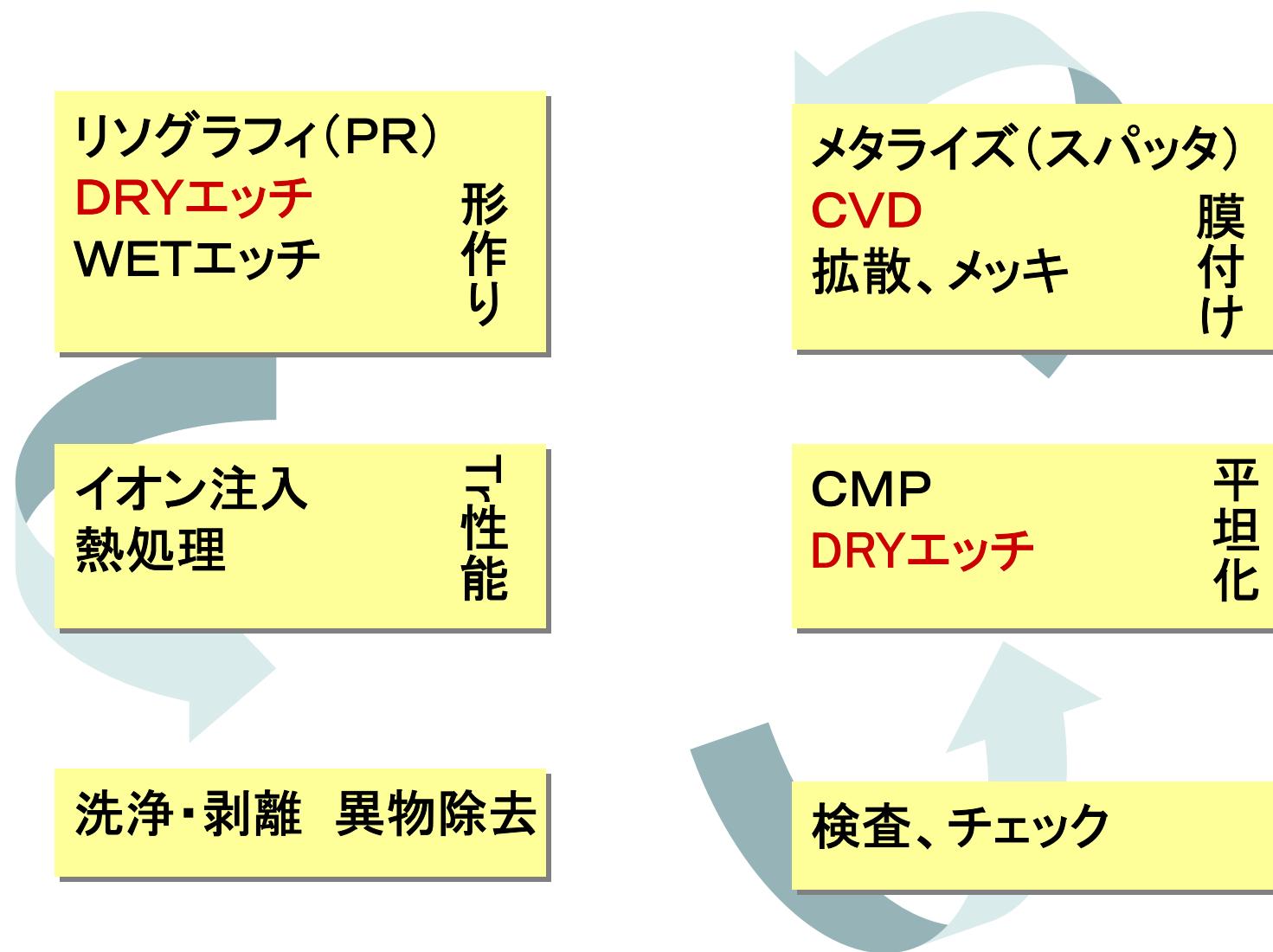
テストカード

# LSIの製造工程

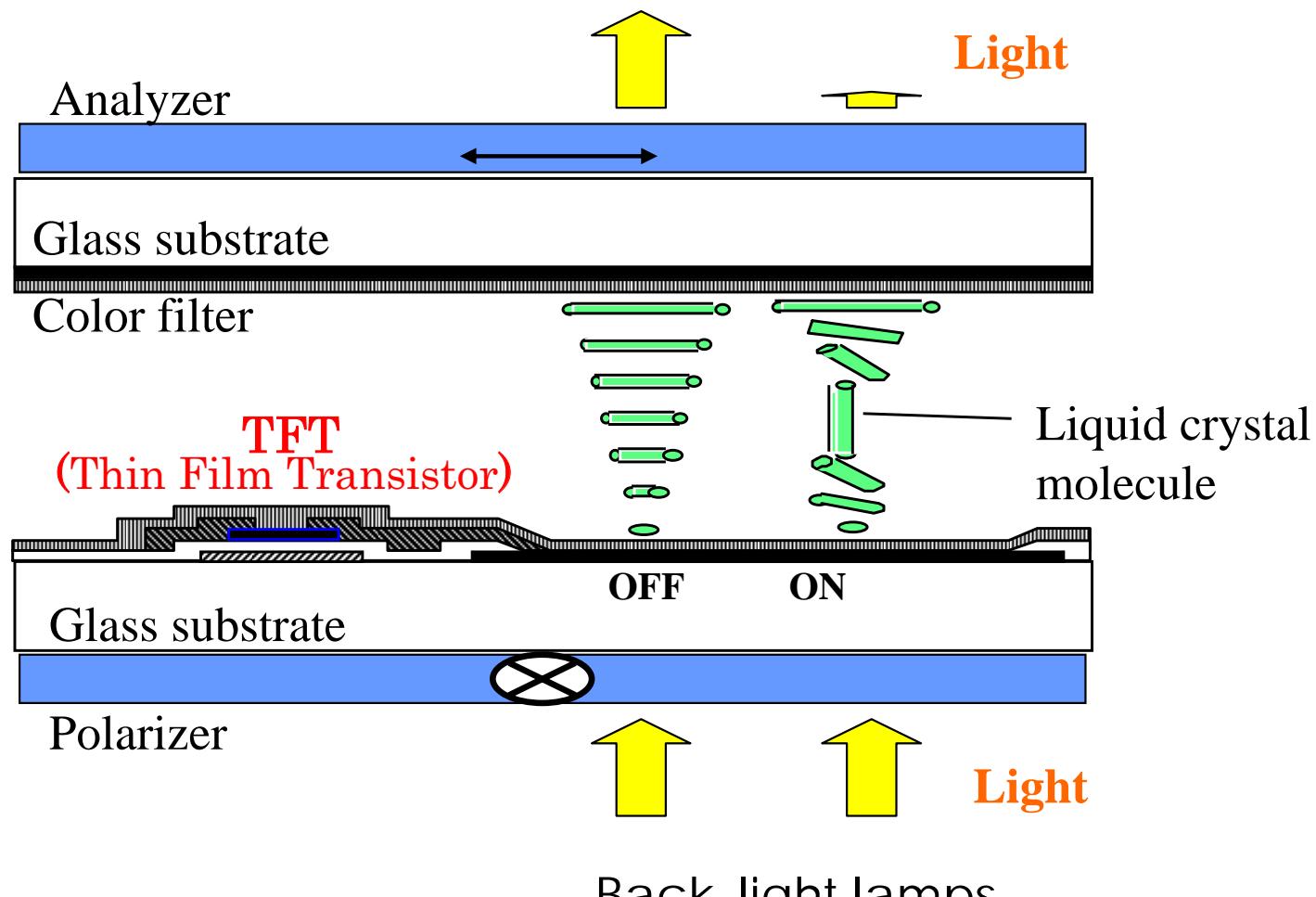
温室効果ガスは全てこの工程



# LSIの製造(パターン形成)



# TFT-LCD構造



LCDパネルの断面図